

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Краткое наименование услуги: Электронно-микроскопические исследования

Наименование организации: ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Инжиниринговый центр развития передовых технологий.

Адрес организации: 426034, Ижевск, ул. Университетская, д.1 (корпус №6, кабинет №003, ИЦРПТ).

1. На сканирующем электронном микроскопе Inspect S50

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения, шт.	Цена, руб.
1	Получение топографии поверхности: стандартный режим съемки ¹	1	2500
Усложнение условий съемки, дополнительно к стандартному режиму			
2	Съемка полупроводниковых/ диэлектрических образцов и/или образцов на полупроводниковой/ диэлектрической подложке	1	1000
3	Напыление углеродной пленки для снятия заряда с поверхности (определяется типом образца)	1	1000
4	Травление образца ионным источником на ВУП-5 (в среде Ar) для удаления органической пленки.	1	1000
5	Увеличение размеров образца до 50x50 мм	1	200
6	Выбор режима увеличения до 180000x по выбору заказчика ²	1	1500
7	Съемка дополнительного количества фотографий с разных мест по выбору заказчика	за 1 фотографию	100
8	Съемка образца в режиме детектирования обратно-отраженных электронов (vCD)	1	700
Микроанализ поверхности (элементный состав), дополнительно к стандартному режиму ³			
9	Интегральный элементный анализ с выбранной площади	за единицу сканируемой области	500
10	Точечный анализ выбранной области (до 3 точек на поверхности)	за единицу сканируемой области	500
11	Линейный анализ (элементный анализ вдоль одной линии, указанной заказчиком)	за единицу сканируемой области	1000
12	Картирование поверхности (по ROI индексу) ⁴	за единицу сканируемой области	1500

¹Стандартный режим съемки состоит в получении топографии поверхности проводящего (металлического) образца размерами до 10x10 мм в режиме высокого вакуума методом детектирования вторичных электронов (ETD). Проводится съемка до 5 (пяти) фотографий поверхности с различным увеличением, по выбору заказчика до

20000x и разрешением до 2048x1768 точек. Максимальный размер образца по высоте до 25 мм.

²Выбор режима увеличения может быть снижен для полупроводниковых/диэлектрических образцов ввиду зарядки поверхности и определяется наилучшими условиями по выбору оператора.

³Микроанализ включает в себя качественный и количественный анализ с указанием весовых и атомных процентов от суммарно определенных элементов по внутренним стандартам специализированного ПО. Определение атомных и весовых процентов на основе эталона заказчика проводится в соответствии с необходимостью дополнительного исследования эталона.

⁴Картирование поверхности проводится в режимах и увеличениях, определяемых наилучшими условиями по выбору оператора.

2. На просвечивающем электронном микроскопе ЭМ-125 К

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения, шт.	Цена, руб.
1	Исследование микроструктуры металлов, сплавов методом фольг: а) приготовление фольг из массивного материала, б) получение снимков	1	25000
2	Исследование микроструктуры материалов методом реплик	1	25000
3	Исследование микроструктуры тонких пленок	1	10000

Увеличение микроскопа при работе с гониометром до 350000, ускоряющее напряжение 100 кВ.

Настоящее предложение действует до 31 декабря 2020 года.

Свяжитесь с нашими сотрудниками:

Ковальчук Андрей Гаврилович,

тел. 66-34-66, 89512150140, e-mail: kovalchuk_ag@udsu.ru

Таболкина Татьяна Викторовна,

тел. 66-34-66, 89199163055, e-mail: ztransfera@yandex.ru